

28 aA 12

GaSb引上げ結晶の微視的成長速度と拡がり抵抗

静岡大 電子研

熊川征司、巽 健治、早川泰弘

回転引上げ法を用いて(111)方向にGaSb単結晶を成長させ、引上げ軸を含む(110)面上の微視的成長速度と拡がり抵抗との関係を調べた。成長速度は結晶成長中に固液界面を通して電流パルスを流し、これによって生じた不純物濃度縞の間隔測定から求めた。拡がり抵抗測定は二端子法を用い、端子間隔は $100\mu\text{m}$ 、端子送りは $20\mu\text{m}$ とした。

図1は種結晶、ルツボ共無回転の時の試料で、同一時刻に成長した界面に沿って測定した拡がり抵抗(R_s)、法線方向の成長速度(V_n)及び成長界面の(111)面からの傾き角度(θ)の結果である。この試料はfacet領域が結晶周辺部のみに存在していた。白印は黒印の8秒後に成長した界面の結果を示している。off-facet域に着目すると、 R_s は結晶周辺部に近づくに従い減少している。他方、黒印の V_n は周辺に向かって増加しており、定性的にはBPS理論を満足していた。しかし白印の傾向を見ると R_s と V_n が直接には結びついていない。これに対し、 R_s は成長時刻が異なった界面に於ても θ と同一の傾向を示した。これは何らかの関係が存在することを示唆している。

図2は結晶回転10rpmの試料の結果である。不純物縞の不明瞭な領域が存在していたために V_n は全領域を通して示されていないが、結晶周辺に行くに従い V_n は増加しており、かつ R_s も増加した。これは明らかにBPS理論を満足しなかった。 R_s は θ とは必ず比例関係があった。それ故、図2の左側のoff-facet域の結果を用いて横方向の成長速度 V_L の計算結果を図3に示す。横軸は R_s で、 V_n と θ は R_s と直線関係があると仮定されている。 V_L の減少に対して R_s は増加しており、これはTrainor等の理論^{*}すなわち横方向の成長速度が結晶中に導入される不純物量を支配する考え方の一一致している。試みにfacetとoff-facet域の各々の不純物の偏析係数の比は各々の領域の R_s の比に逆比例すると仮定すると、実験結果の V_L と理論のそれを合せることにより $V_{\text{facet}}/V_{\text{off}} = 14.9 \pm 0.6$ の値を得た。報告されている値

に比べるとかなり大きい。 R_s と V_L が逆比例するという考え方には理がありであろう。

^{*}A. Trainor and B.E. Bartlett: Solid State Elect. 2 106 (1961).

